

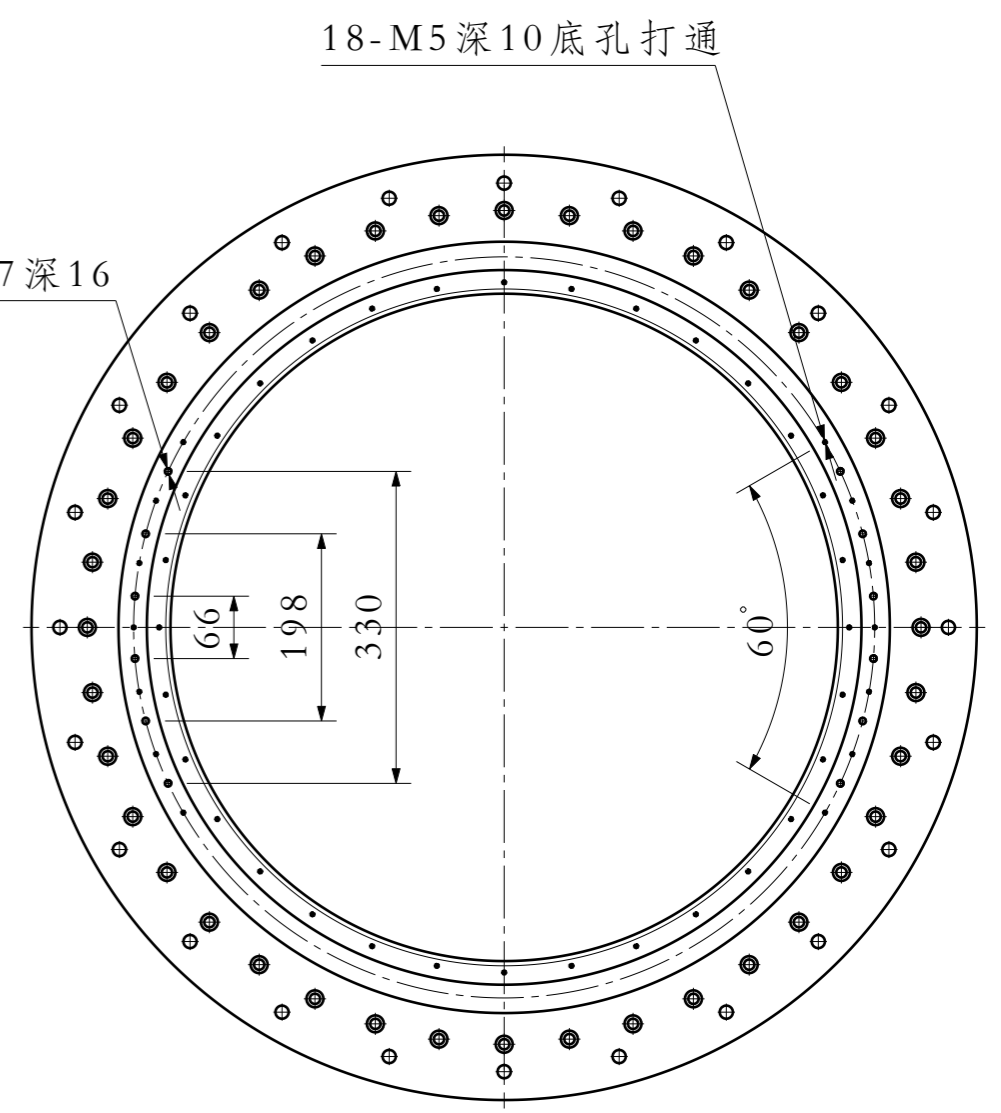
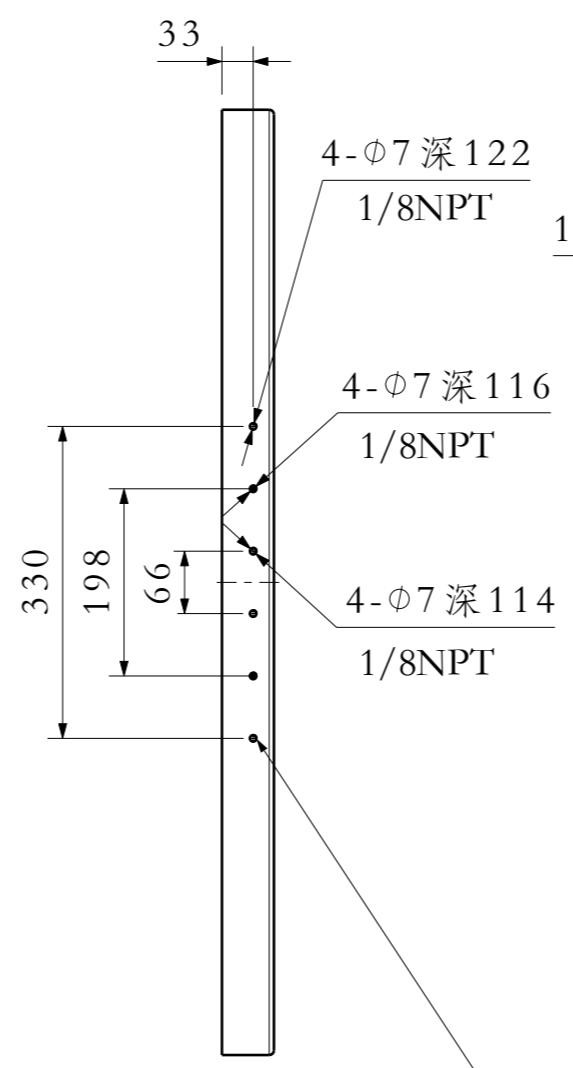
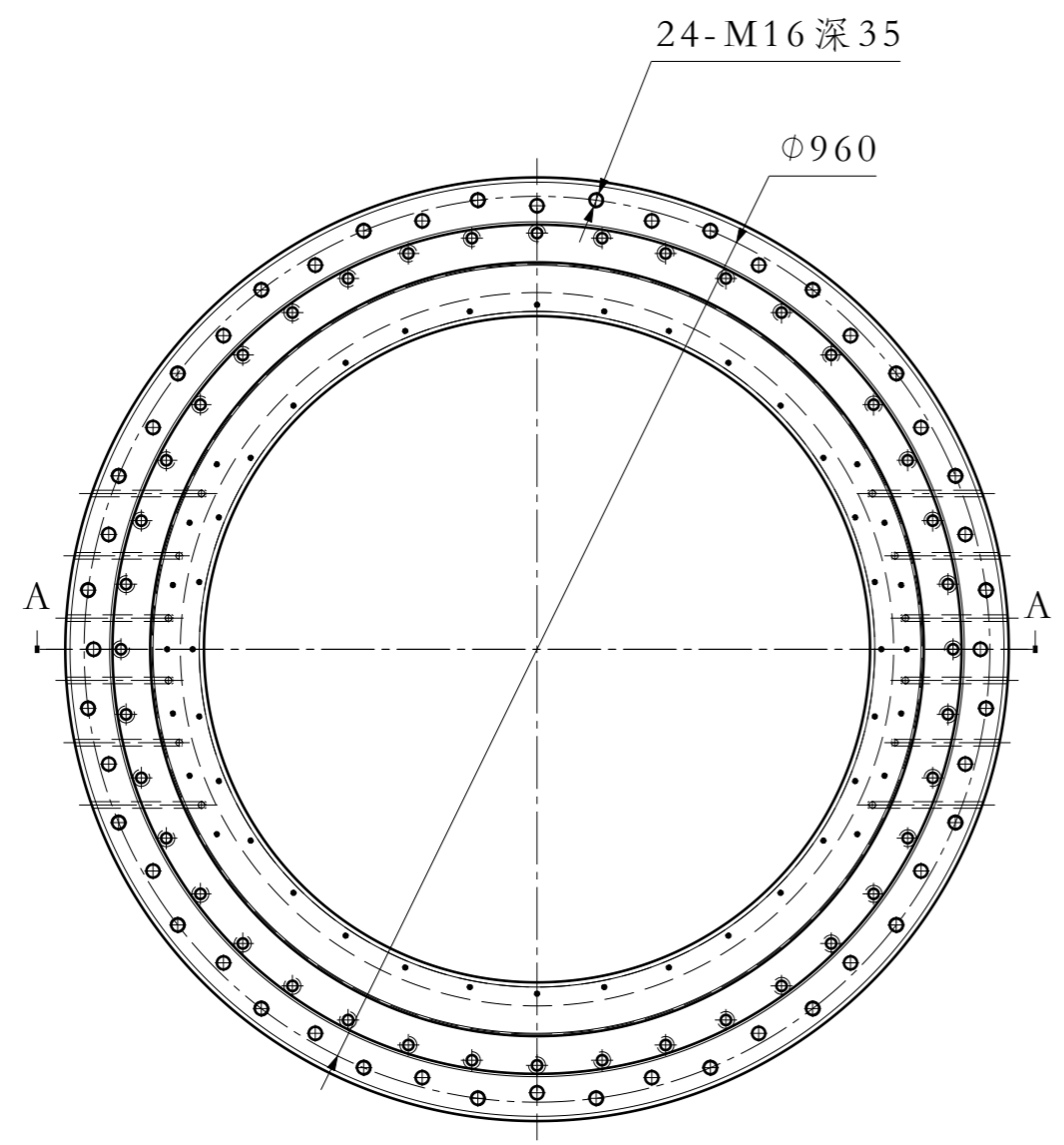
技术要求:

1. 氦质谱检漏, 1atm压差下漏率不超过 $1E-9 Pa \cdot m^3/s$ 。
2. 零件在装配前必须清理和清洗干净;
3. 装配过程中零件不允许磕、碰、划伤;
4. 与PEEK绝缘筒连接螺栓使用PEKK材质, 装配保证相应尺寸。

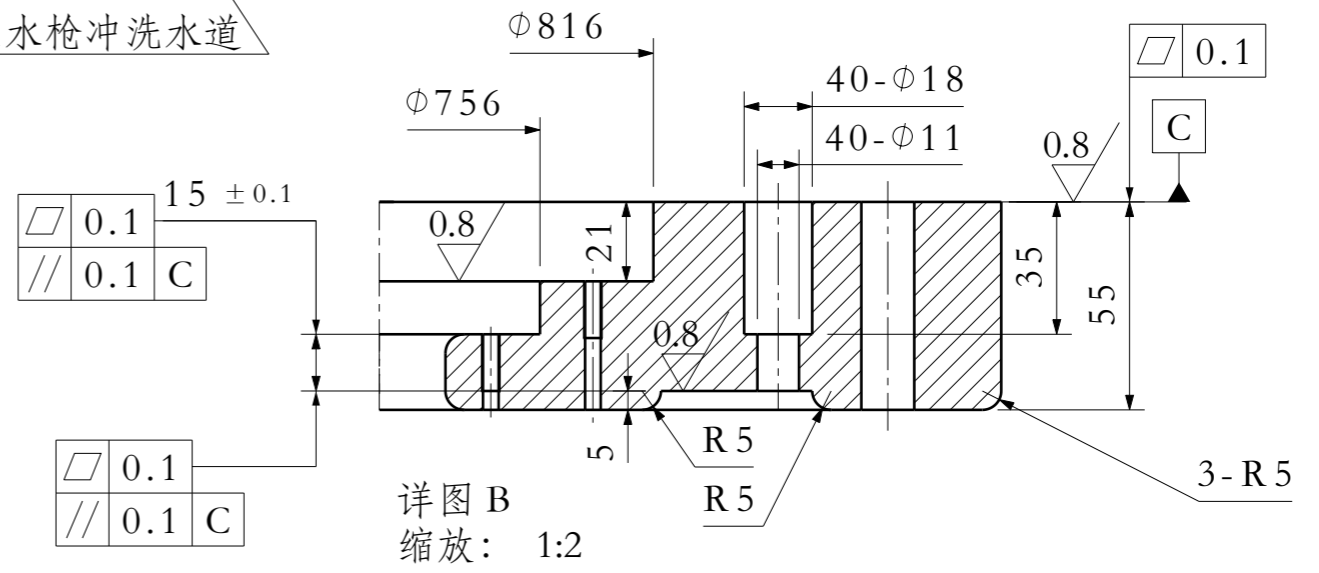
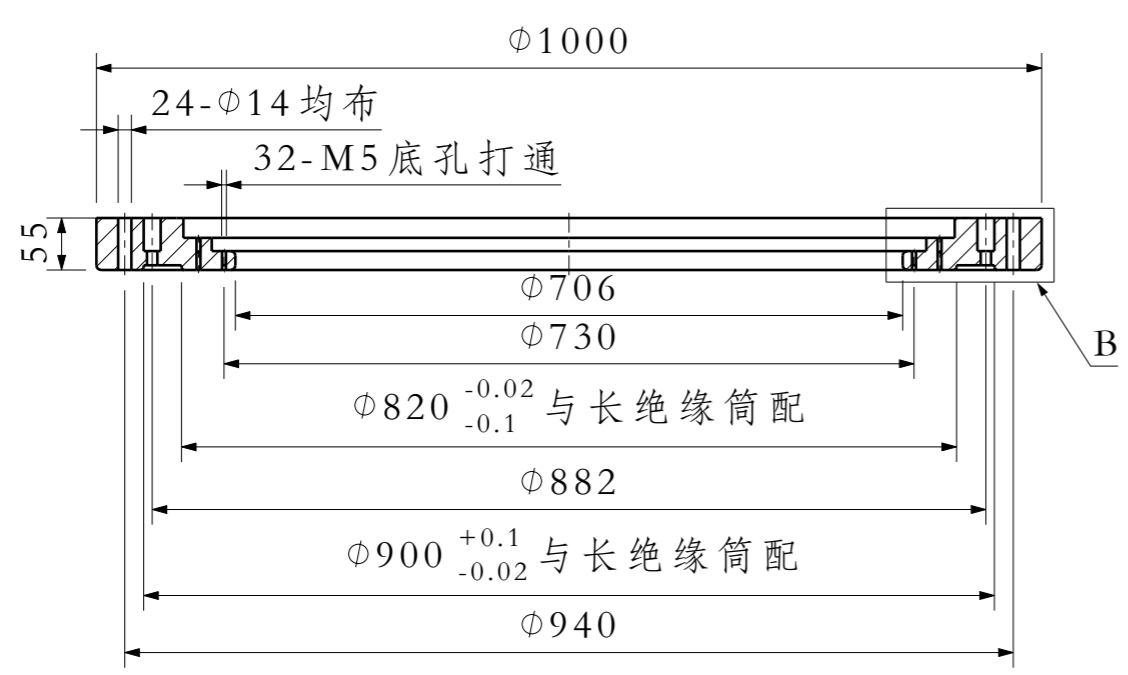
7	CIS-B-0107	电极真空室安全拉杆	PEEK	12	
6	CIS-B-0106	GG水管	304+TU1	2	
5	CIS-B-0105	PG电极支撑	304	1	
4	CIS-B-0104	短绝缘筒	PEEK	1	
3	CIS-B-0103	EG支撑法兰	304	1	
2	CIS-B-0102	长绝缘筒	PEEK	1	
1	CIS-B-0101	GG支撑法兰	304	1	
序号	图号	名称	材质	数量	备注

						CIS-B-0100		版本号	
						电极真空室		NBI	
						装配图		1/4尺寸射频负离子源	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	ACAD文件名	数量	比例	中国科学院 等离子体物理研究所
设计			工艺				1	1:8	
绘图			标准化						
校对			审定						
审核									
会签			批准			共	张	第	张

其余 $\nabla 3.2$

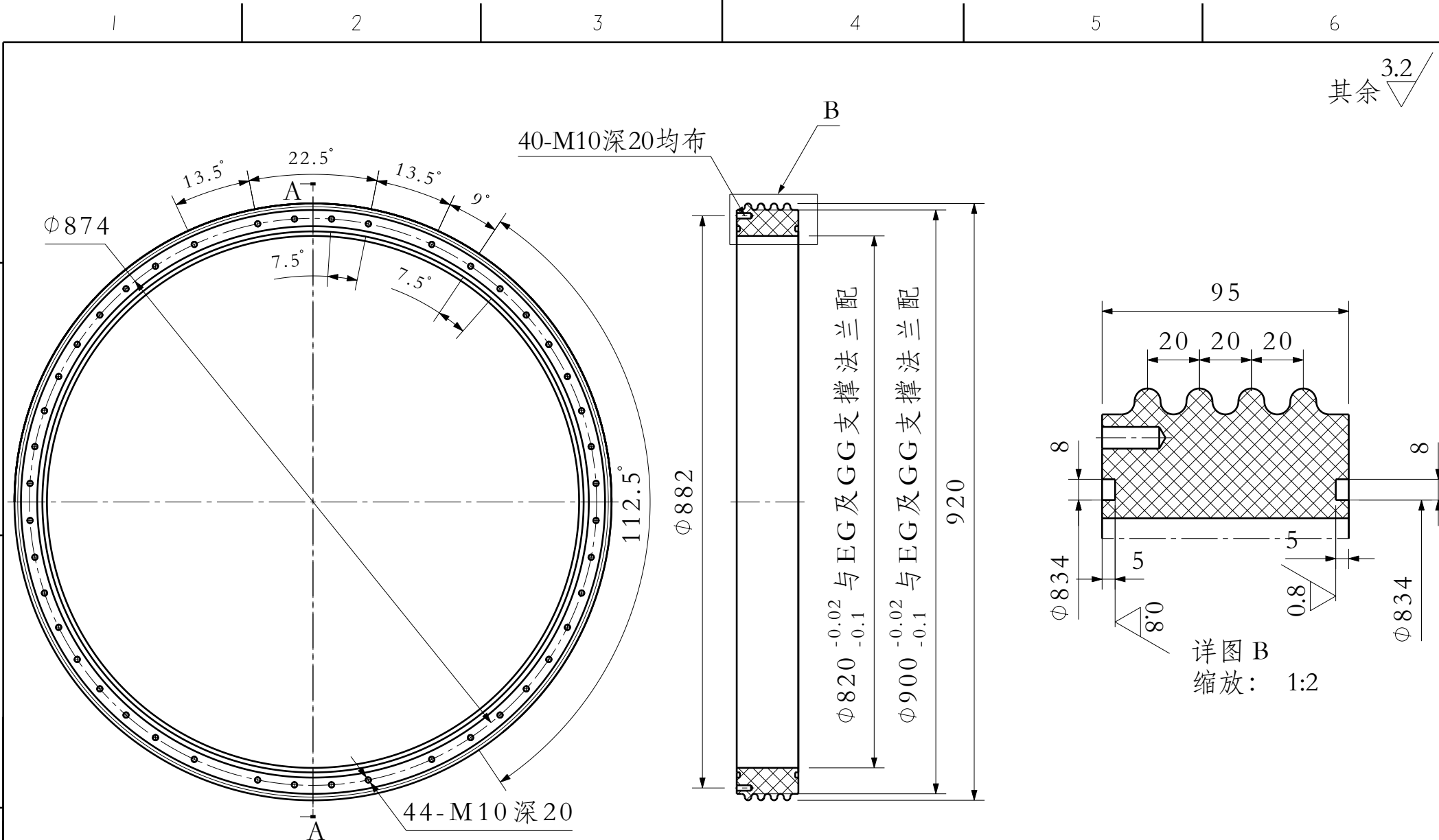


所有水路加工完成后接入高压水枪冲洗水道



技术要求:
 1. 去除毛刺, 清洗油污。

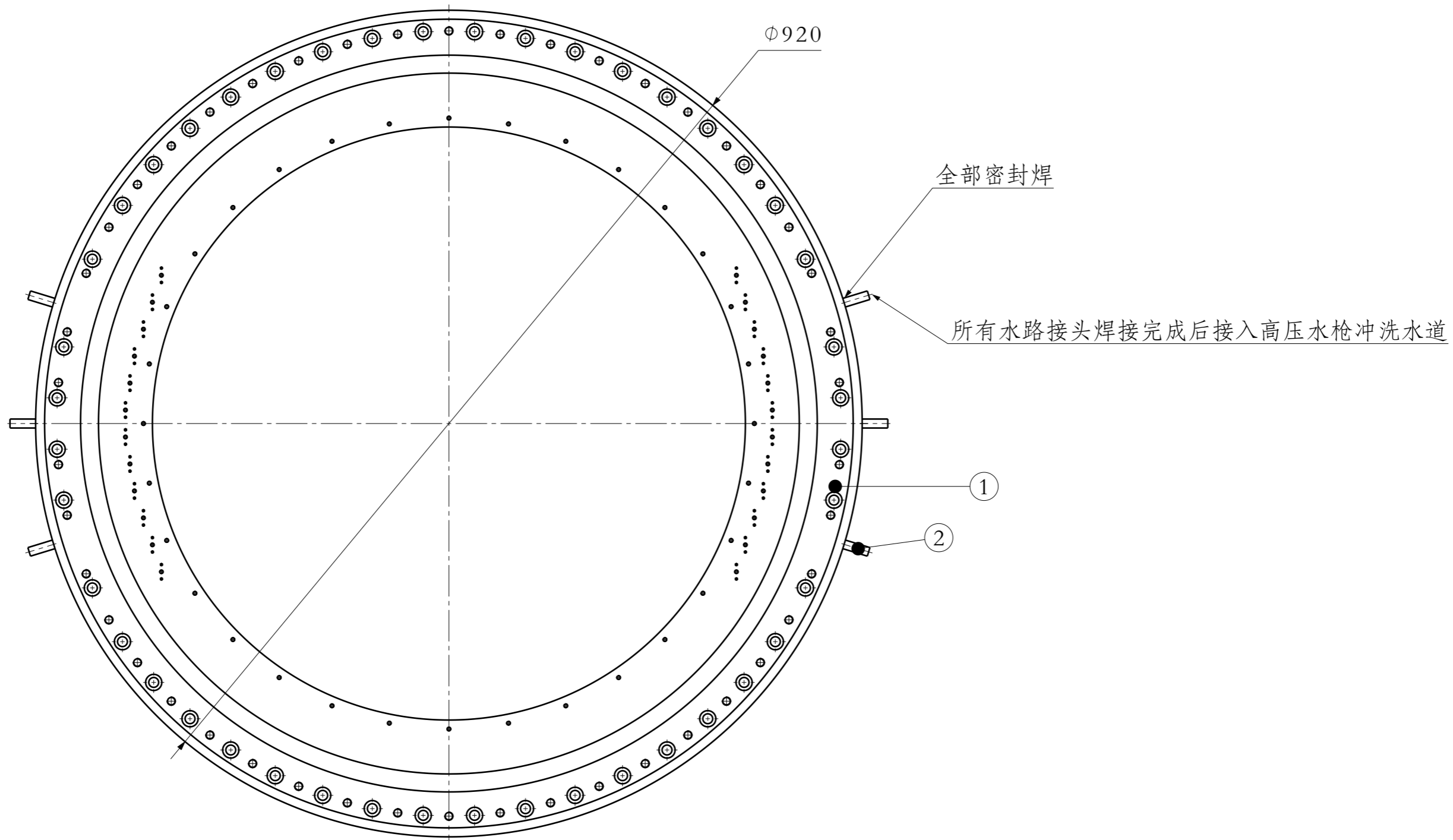
						CIS-B--0101		版本号	
						GG支撑法兰		NBI	
						304		1/4尺寸射频负离子源	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	ACAD文件名	数量	比例	中国科学院 等离子体物理研究所
设计			工艺				1	1:8	
绘图			标准化						
校对			审定						
审核									
会签			批准			共	张	第	张



其余 $\sqrt{3.2}$

					CIS-0102			版本号
					短绝缘筒			NBI
					PEEK			1/4尺寸射频负离子源
					ACAD文件名		数量	比例
							1	1:6
					共 张		第 张	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日			
设计			工艺					
绘图			标准化					
校对			审定					
审核								
会签			批准					

中国科学院
等离子体物理研究所

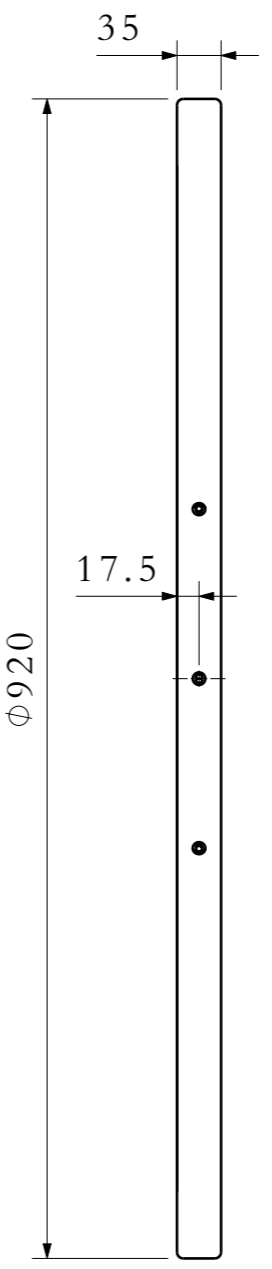
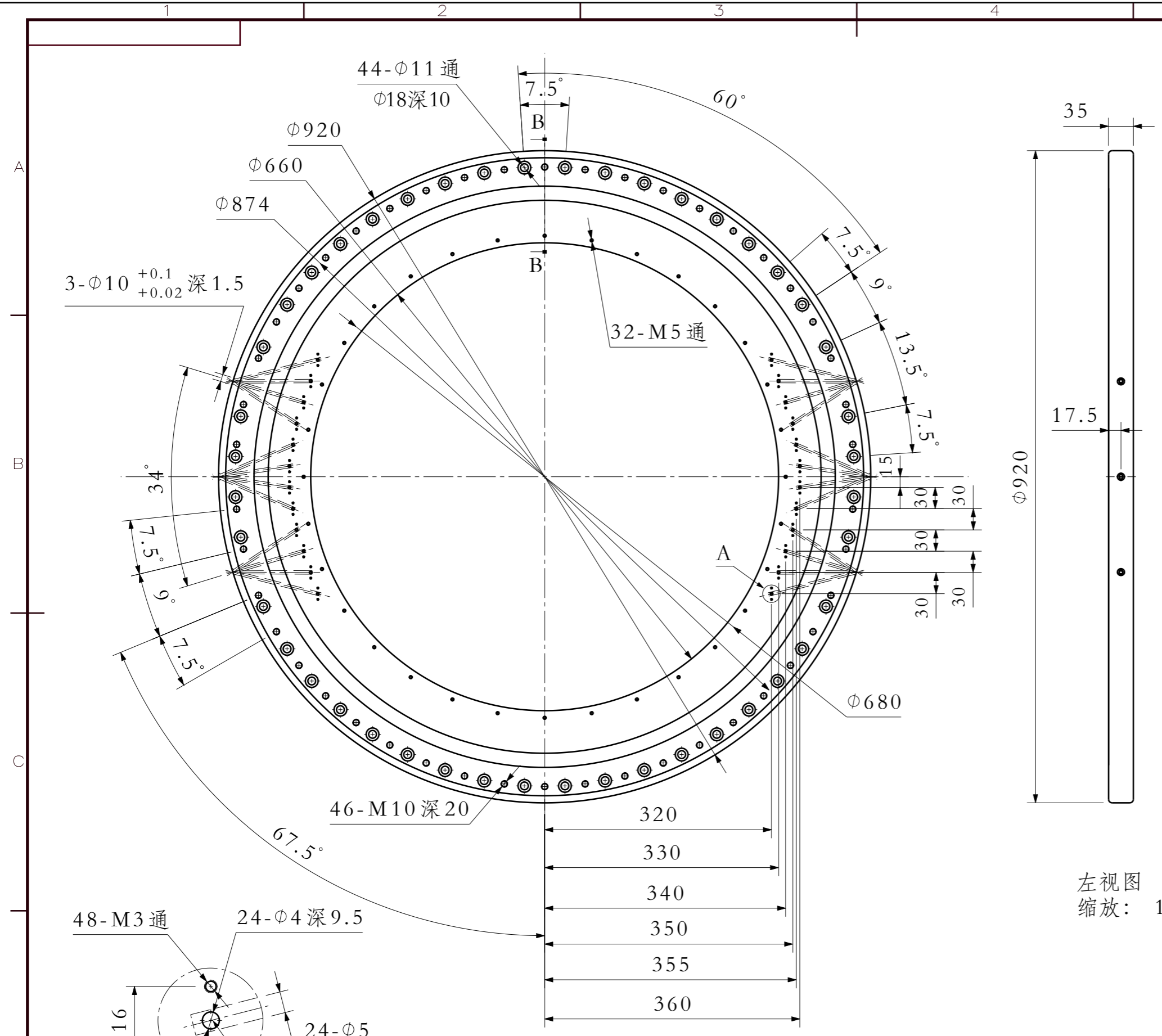


技术要求：
1.去除毛刺，清洗油污，打压检漏2MPa。

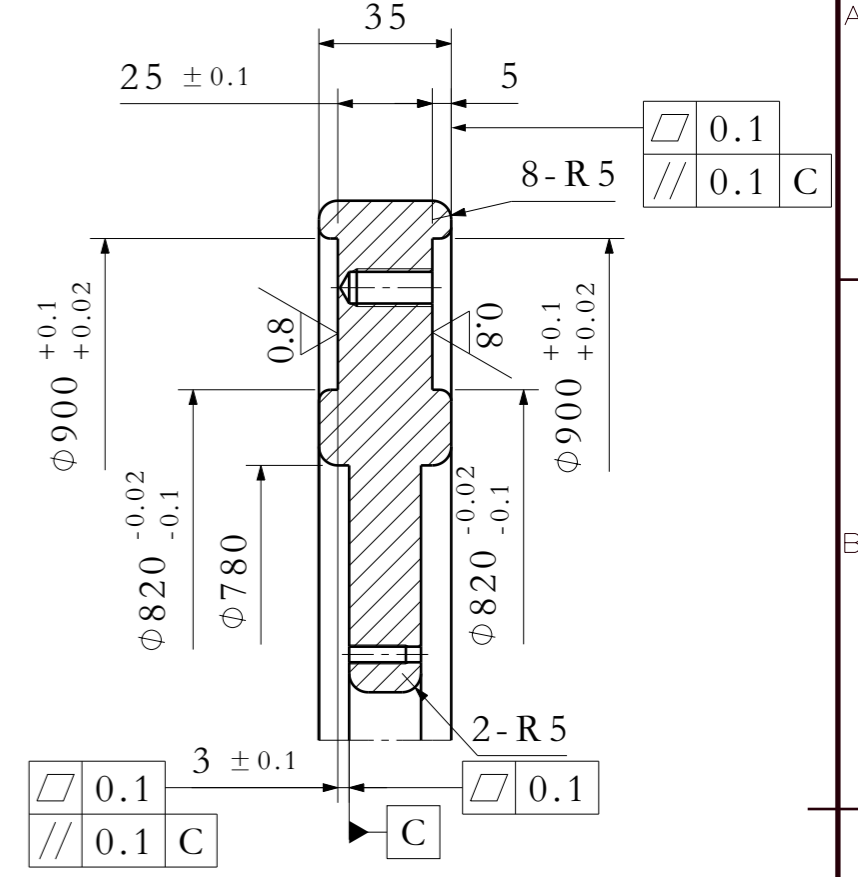
序号	图号	名称	材质	数量	备注
2	CIS-0103-02	EG支撑法兰水管	304	6	
1	CIS-0103-01	EG支撑法兰盘	304	1	

						CIS-0103		版本号	
						EG支撑法兰		NBI	
						焊接图		1/4尺寸射频负离子源	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	ACAD文件名	数量	比例	中国科学院 等离子体物理研究所
设计			工艺				1	1:8	
绘图			标准化						
校对			审定						
审核									
会签			批准			共	张	第	张

其余 $\sqrt{3.2}$

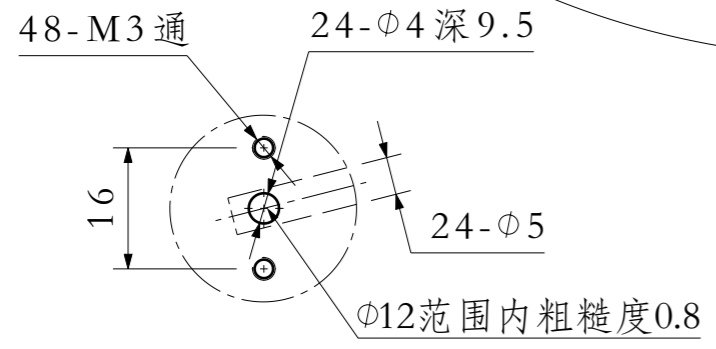


左视图
缩放: 1:6



剖视图 B-B
缩放: 1:2

技术要求:
1. 去除毛刺, 清洗油污, 打压检漏2MPa。



详图 A
缩放: 1:1
共24处

						CIS-0103-01			版本号
						EG支撑法兰盘			NBI
						304			1/4尺寸射频负离子源
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	ACAD文件名	数量	比例	中国科学院 等离子体物理研究所
设计			工艺				1	1:8	
绘图			标准化						
校对			审定						
审核			批准						
会签						共	张	第	张

1 2 3 4 5 6

A

A

B

B

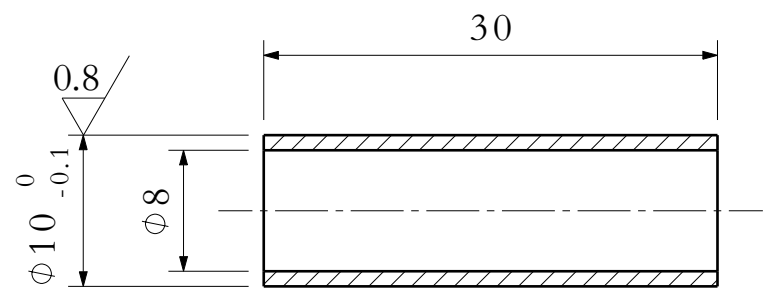
C

C

D

D

其余 $\sqrt{3.2}$

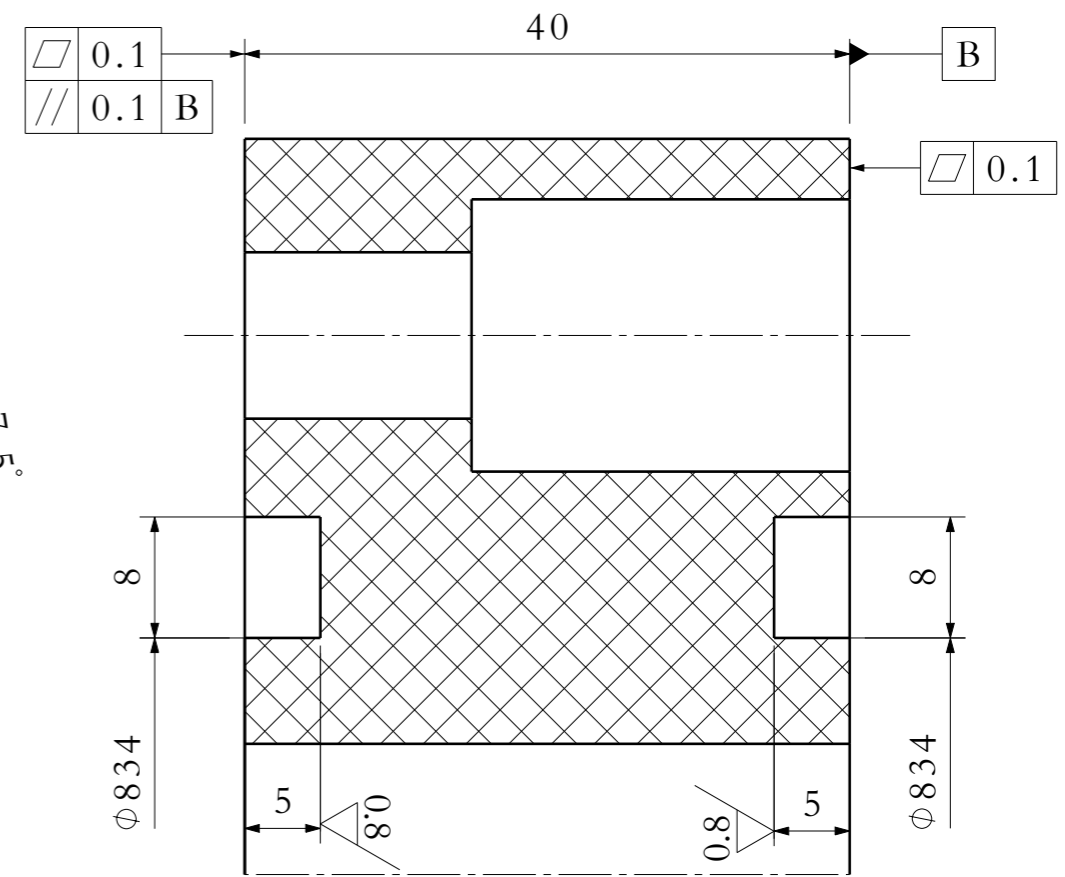
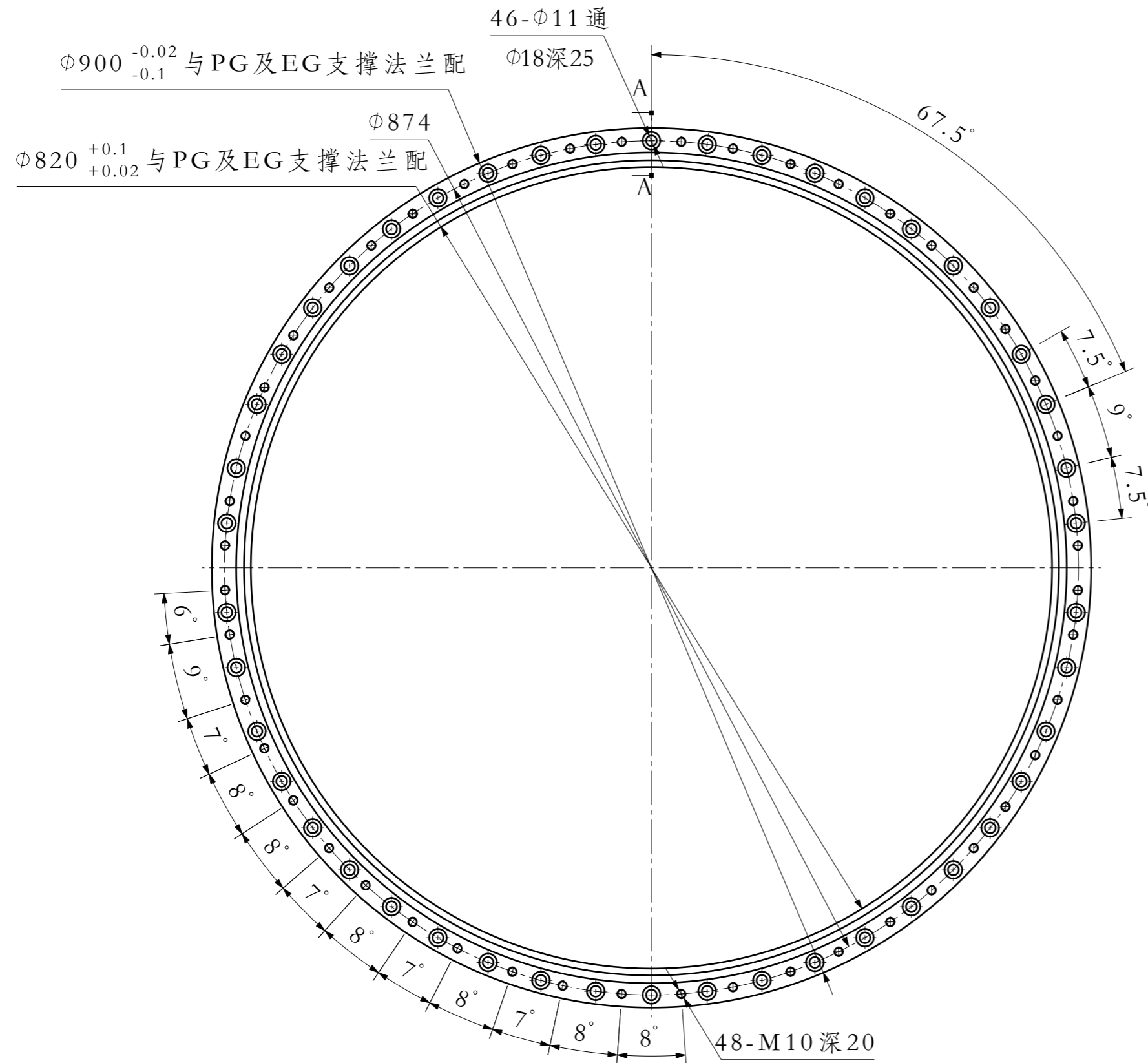


						CIS-0103-02		版本号	
						EG支撑法兰水管		NBI	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	304		1/4尺寸射频负离子源	
设计			工艺			ACAD文件名	数量	比例	中国科学院 等离子体物理研究所
绘图			标准化				6	2:1	
校对			审定						
审核			批准			共	张	第	
会签									

技术要求：
1.去除毛刺，清洗油污。

1 2 3 4 5 6

其余 $\nabla 3.2$

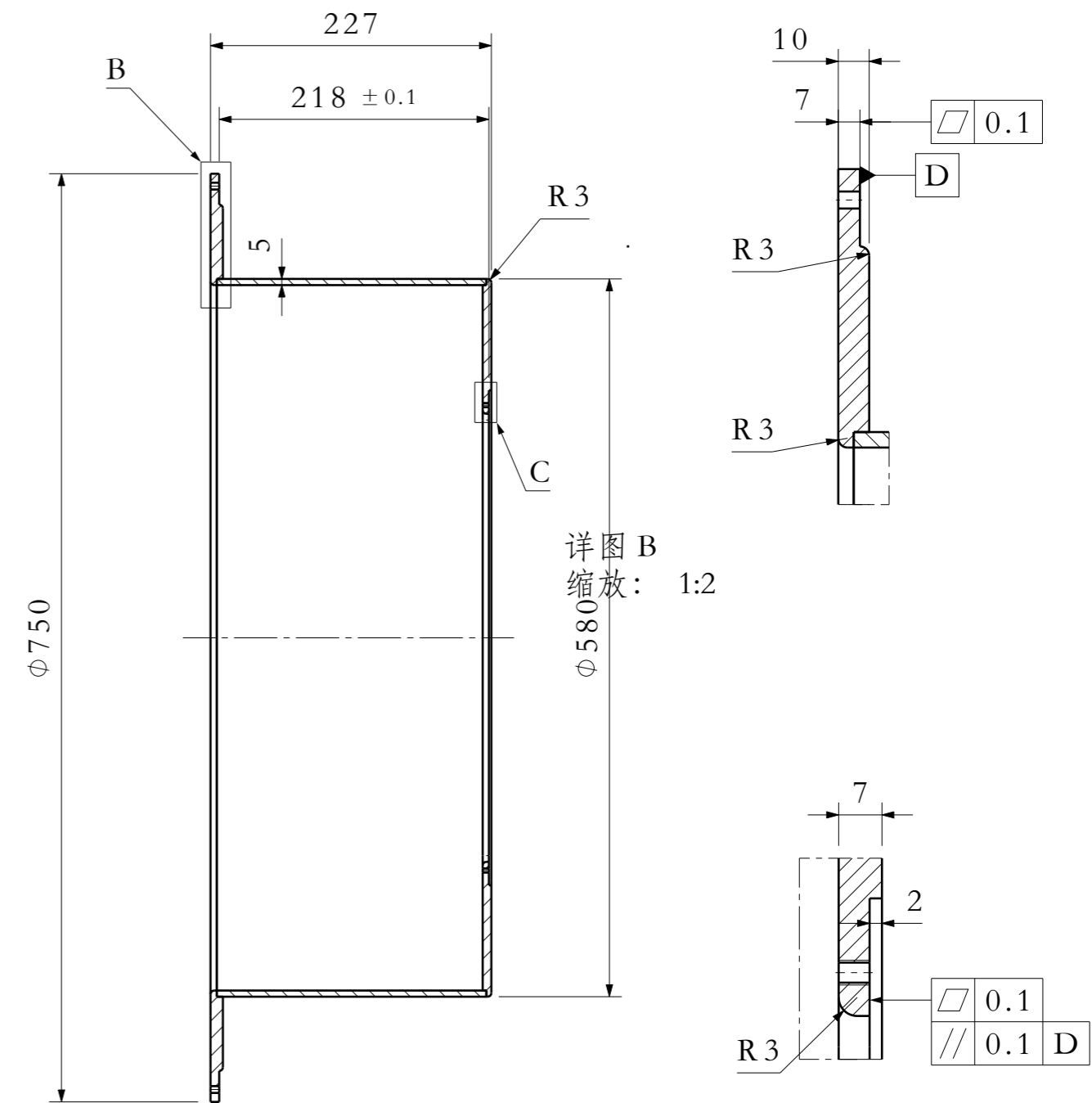
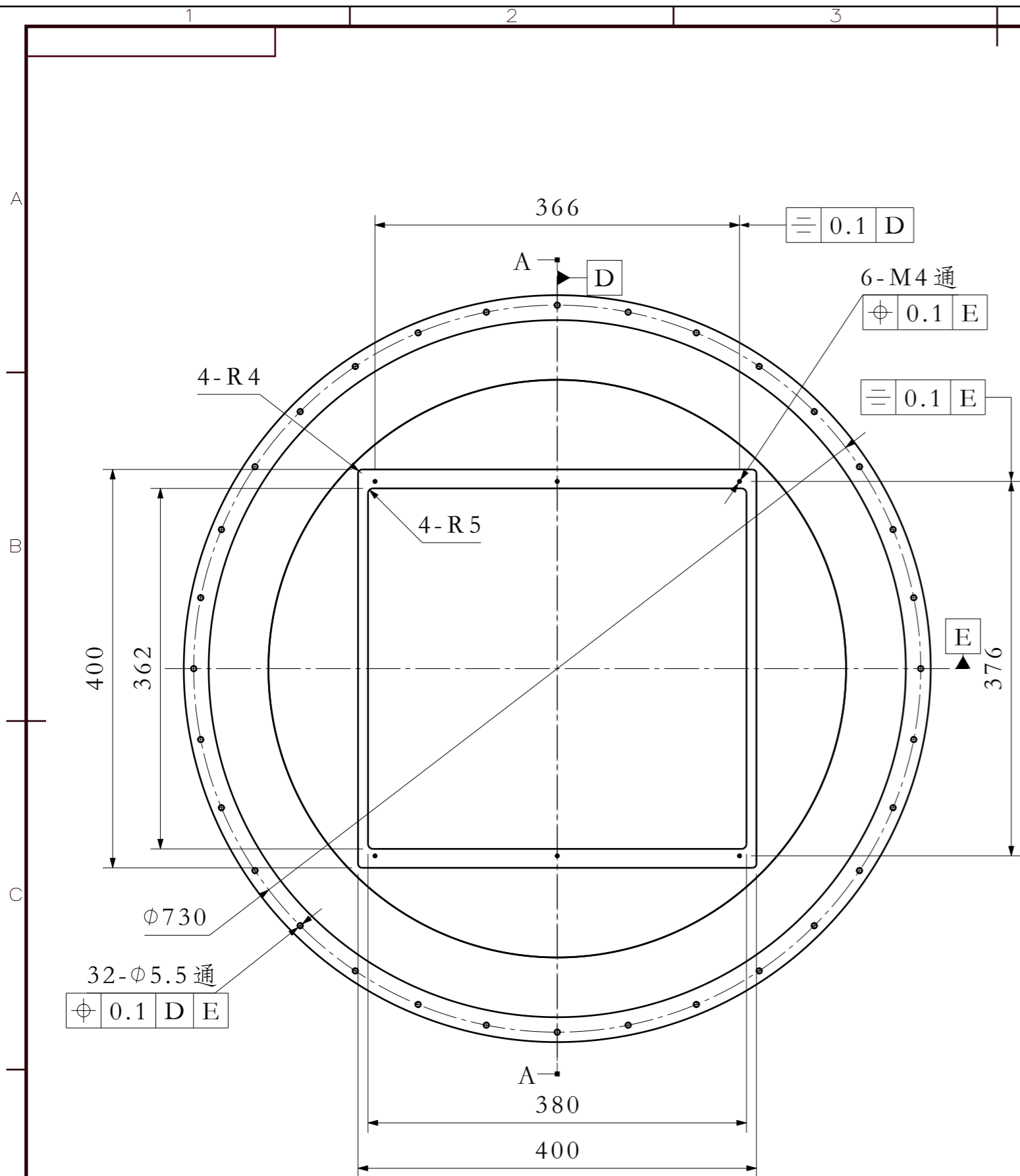


剖视图 A-A
缩放: 2:1

技术要求:
1. 去除毛刺, 清洗油污。

						CIS-0104			版本号	
						短绝缘筒			NBI	
						PEEK			1/4 尺寸射频负离子源	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	ACAD 文件名	数量	比例	中国科学院 等离子体物理研究所	
设计			工艺				1	1:8		
绘图			标准化							
校对			审定							
审核						共	张	第	张	
会签			批准							

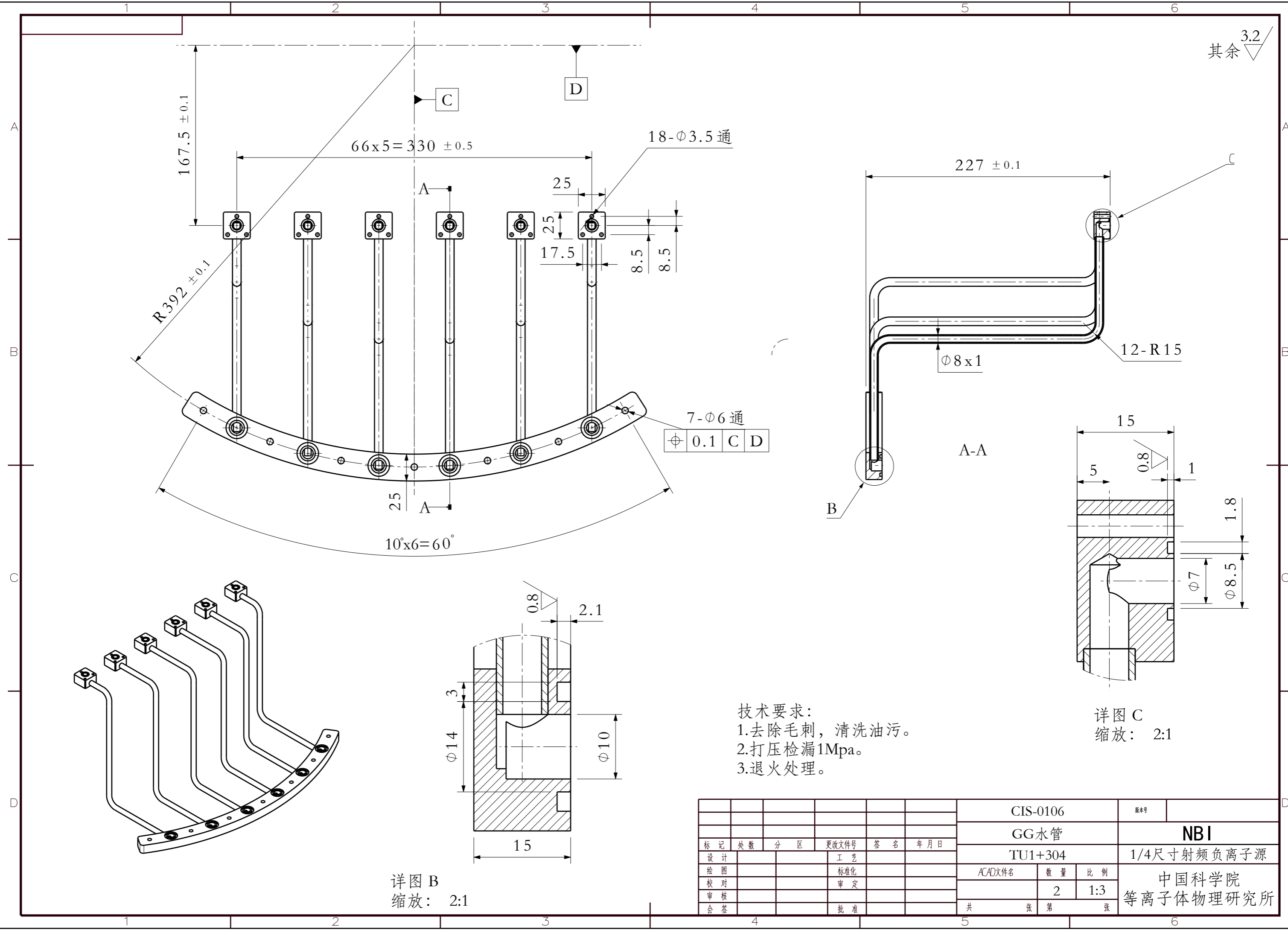
其余 $\nabla 3.2$



技术要求:
1.去除毛刺,清洗油污。

						CIS-0105			版本号	
						GG电极支撑			NBI	
						304			1/4尺寸射频负离子源	
设计						ACAD文件名	数量	比例	中国科学院 等离子体物理研究所	
绘图							1	1:5		
校对										
审核										
会签						共	张	第	张	

其余 $\nabla 3.2$



7- $\Phi 6$ 通
 $\oplus 0.1$ C D

技术要求:
 1.去除毛刺,清洗油污。
 2.打压检漏1Mpa。
 3.退火处理。

详图 C
 缩放: 2:1

详图 B
 缩放: 2:1

						CIS-0106		版本号
						GG水管		NBI
						TU1+304		1/4尺寸射频负离子源
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	ACAD文件名	数量	比例
设计			工艺				2	1:3
绘图			标准化					
校对			审定					
审核								
会签			批准			共	张	第
						张	张	中国科学院 等离子体物理研究所

1 2 3 4 5 6

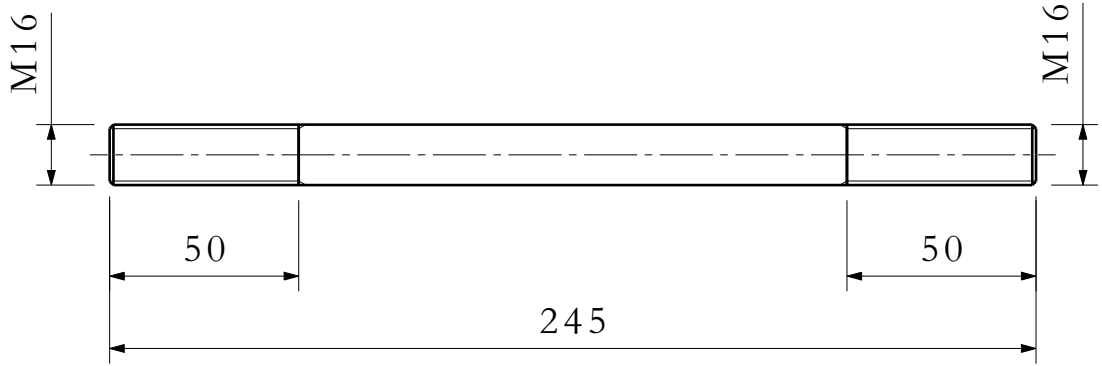
其余 ∇ 3.2

A

A

B

B



C

C

D

D

技术要求：
1.去除毛刺，清洗油污。

						CIS-0107			版本号	
						电极真空室安全拉杆			NBI	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	PEEK			1/4尺寸射频负离子源	
设计			工艺			ACAD文件名	数量	比例	中国科学院 等离子体物理研究所	
绘图			标准化				12	1:2		
校对			审定							
审核			批准			共	张	第		
会签										

1 2 3 4 5 6